

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 1 区分
 【発行日】平成 28 年 7 月 28 日 (2016.7.28)

【公開番号】特開 2014-239012 (P2014-239012A)
 【公開日】平成 26 年 12 月 18 日 (2014.12.18)
 【年通号数】公開・登録公報 2014-070
 【出願番号】特願 2013-122042 (P2013-122042)
 【国際特許分類】

H 0 1 J 37/20 (2006.01)

H 0 1 J 37/28 (2006.01)

【F I】

H 0 1 J 37/20 D

H 0 1 J 37/20 Z

H 0 1 J 37/28 B

【手続補正書】
 【提出日】平成 28 年 6 月 8 日 (2016.6.8)

【手続補正 1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

荷電粒子又は電磁波の何れかをビームとして発生させるビーム発生手段と、
 ワーキングチャンバ内において可動ステージ上に保持された検査対象に、前記ビームを
 導き照射する 1 次光学系と、
 前記検査対象から発生した二次荷電粒子を検出する 2 次光学系と、
 検出された前記二次荷電粒子に基づいて画像を形成する画像処理系と、
前記可動ステージを駆動させるリニアモータと、
 前記可動ステージを駆動させるときに前記リニアモータから発生する磁場を相殺するた
 めの磁場を発生させるヘルムホルツコイルと、
前記リニアモータを駆動させる駆動電流を検出する電流検出手段と、
前記電流検出手段により検出された駆動電流に応じて、前記ヘルムホルツコイルから発
生させる磁場の強度を制御する磁場制御手段と、
 を備えることを特徴とする検査装置。

【請求項 2】

前記可動ステージの位置を検出する位置検出手段を備え、
 前記磁場制御手段は、前記電流検出手段により検出された駆動電流と前記位置検出手段
 により検出された位置に応じて、前記ヘルムホルツコイルから発生させる磁場の強度を制
 御する、請求項 1 に記載の検査装置。